

# 走査電子顕微鏡 (日立 S5200)

## 【装置概要】

- ・電界放出型走査電子顕微鏡 (FE-SEM)
- ・各種材料の表面状態，および透過像を高倍率で観察する装置

## 【日時】

平成30年12月7日（金） 9:30 ~ 12:00

## 【場所】

岡山大学新技術センター106号室

## 【概要】

- ・測定装置の概要等の説明（106号室）
- ・装置操作法の実地講習（106号室）

## 【講師】

岡山大学異分野融合先端研究コア 大久保 智子（監守者）

## 【申込み方法】

自己測定ご希望の方は必ず受講してください。

実地講習受講人数には上限があります（10名）。

11月30日（金）までに，所属，氏名，職位（学年）を記載し，下記宛にメールでお申込みください。

岡山大学異分野融合先端研究コア（内線8711）

e-mail: t\_ohkubo@okayama-u.ac.jp（本件担当：大久保）